Nikon

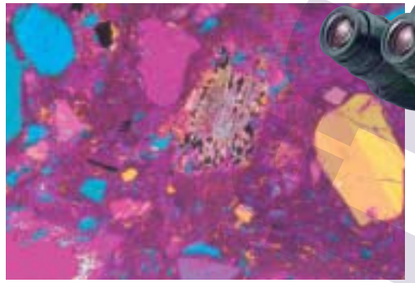
Поляризационный микроскоп

ECLIPSE
E200POL

CFI60

SIGMA group of companies

Экономичный поляризационный микроскоп с уникальной «бесконечной» оптикой CFI60 от Nikon.



Микроскоп E200POL имеет невероятно компактную конструкцию и занимает немного места на рабочем столе, благодаря чему с ним легко работать и несложно транспортировать. Благодаря тому, что конструкция E200 POL создана на базе биологического микроскопа Eclipse E200, он имеет те же объективы, и к нему подходят многие дополнительные принадлежности, разработанные для микроскопов серии Eclipse более высокого класса, что позволяет осуществлять передовые микроскопические исследования в свете поляризации. Как вы могли предположить, микроскоп E200POL обладает той же простотой в обращении и прочностью конструкции, свойственной другим микроскопам серии Eclipse.

Стандартная комплектация E200POL (фильтр поставляется отдельно)

¼ λ пластина

На одной направляющей установлена ¼ λ пластина и красная пластина первого порядка, благодаря чему возможно проведение количественных измерений образца.

Поворотный столик

Прецизионный центрируемый столик имеет шкалу нониуса с делением 0.1°, что позволяет проводить точные измерения азимутальных углов.

Коноскопическое наблюдение

Система оснащается промежуточным тубусом с линзами Бертрана для наблюдения коноскопических изображений. Эта функция идеально подходит для идентификации одноосных и двуосных кристаллов, а также для оценки других оптических характеристик, например, оптических знаков.

Фильтры

Синий фильтр «дневного света» обеспечивает правильную цветопередачу при проведении оценки образцов, в то время как GIF фильтр используется при измерениях процессов замедления и регулировки контрастности.

Компенсаторы

Для количественных измерений процессов замедления используются компенсаторы Сенармона и кварцевый клин.

Компенсатор Сенармона

Кварцевый клин

Микрофотография

При установке микрофотографической насадки H-III серии FX-III на тринокулярный тубус, возможно документирование наблюдаемых изображений на 35-мм пленку. Эта система удобна и проста в эксплуатации как никогда ранее и имеет функцию автоэкспозиции, 1% измеритель светового пятна, 35% интегрированный измеритель экспозиции, а также простые и удобные элементы управления, встроенные в основной блок.

Эпископический осветитель L-IM

Установка эпископического осветителя падающего света с галогеновым источником света 12 В, 50 Вт обеспечивает возможность проведения исследований в отраженном поляризованном свете.

CFI LU Plan Epi P

CFI60 «бесконечная» оптика

Оптическая система CFI60 сочетает в себе знаменитую оптику Nikon CF и «бесконечную» оптическую систему построения изображения, что позволяет преодолеть ограничения, присущие традиционным схемам «бесконечной» оптики. Оптическая система CFI60 обеспечивает большее рабочее расстояние и более высокие числовые апертуры, а также позволяет получить удивительно четкие и яркие изображения при любом увеличении, благодаря коррекции хроматических аберраций по всему полю зрения.

Револьвер объективов обратного типа

Револьвер объективов с центровочным механизмом обратного типа, с наклоном к штативу (от наблюдателя), обеспечивает наличие большего пространства во фронтальной части предметного столика, что облегчает и ускоряет работу с предметными стеклами. Еще одно преимущество объективов CFI60 состоит в том, что из-за увеличенной длины и рабочего расстояния вокруг револьверной головки образуется больше свободного места.

Комфортное наблюдение

Окулярный тубус типа Siedentopf – P-TB бинокулярный или P-TT тринокулярный имеет угол наклона 30°, что обеспечивает комфортное наблюдение оператора в естественном положении.

Бинокулярный тубус P-TB

Тринокулярный тубус P-TT

Рефокусируемый предметный столик с ограничителем верхнего перемещения

Уникальный предметный столик с функцией рефокусировки облегчает и ускоряет работу с образцами. Предметный столик может быстро опускаться для смены образцов или добавления иммерсионного масла на предметное стекло, одним нажатием на рычажок. Если убрать руку с рычажка, столик возвращается в исходное положение.

Удобная замена лампы

Микроскоп оборудован уникальным галогеновым осветителем 6 В/20 Вт с верхним доступом. Для замены лампы просто отодвиньте в сторону крышку линзового блока.

Прочная, виброустойчивая конструкция

Монолитный корпус микроскопа - от оптической головки до штатива, и широкое основание (188,5 мм) - обеспечивает прочность всей конструкции и устойчивость к вибрациям. В микроскопе E200 POL превосходная оптика Nikon соединяется с прочной, виброустойчивой конструкцией.

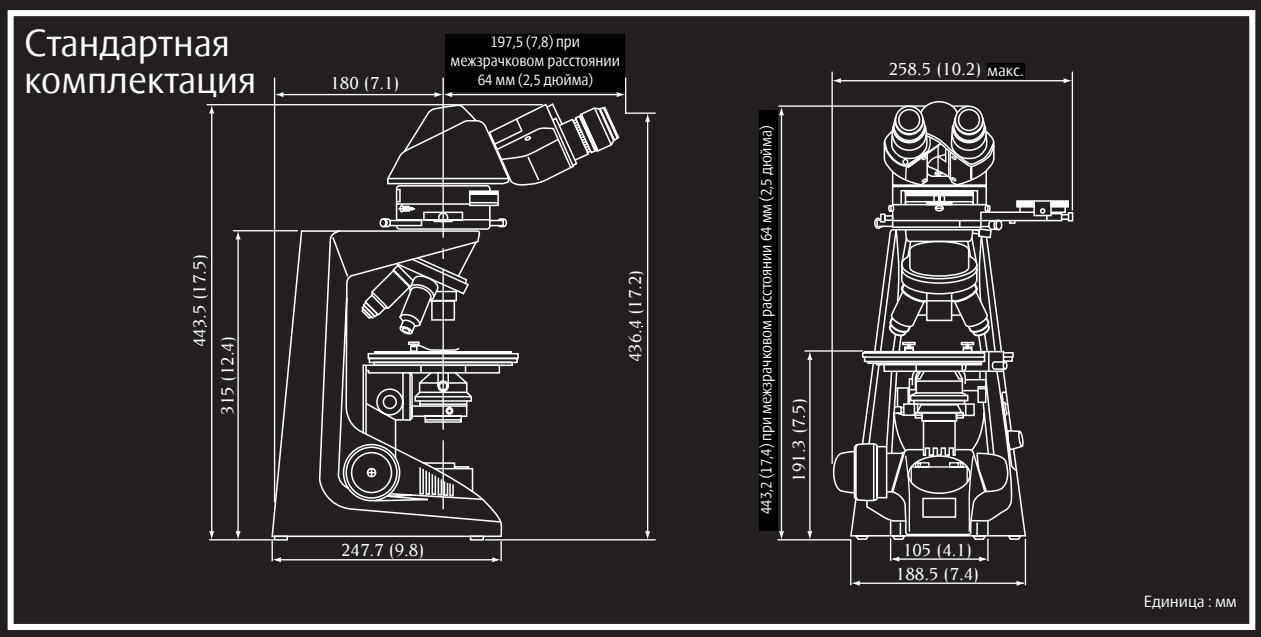
E200POL

Стандартная комплектация (фильтр поставляется отдельно)

Для максимальной экономической выгоды предлагается базовая комплектация E200POL:

- Можно выбрать бинокулярный тубус E2-TB или тринокулярный тубус E2-TF. Повернув переднюю часть тубуса 180°, можно поднять уровень выходных зрачков окуляров на 34 мм.
- Окуляры: CFI E 10X (F.O.V. 20 мм)
- Превосходное соотношение цена-качество

Габаритные размеры



Характеристики

Оптическая система	«Бесконечная» оптика CFI60
Диапазон увеличений	40-1500X для наблюдения; 8-500X для 35 мм микрофотографии
Окуляры	Стандартная комплектация: 10x (F.O.V. 22 мм), тип CM с перекрестием и микрометрической шкалой Базовая комплектация: 10X (F.O.V. 20 мм)
Окулярный тубус	Базовая комплектация: Бинокуляр P-TB, Тринокуляр P-TT Базовая комплектация: Бинокуляр E2-TB, Тринокуляр E2-TF
Промежуточный тубус	Встроенная фокусируемая линза Бертрана, убираемая из оптического пути; переключение между коноскопическим/ортоскопическим режимами наблюдения; встроенный анализатор; слот для пластины/компенсатора.
Анализатор	Шкала поворота на 360°; минимальный угол поворота 0,1°
Револьвер объективов	Четырехместный револьвер объективов, закрепленный на штативе

Грубая/точная фокусировка	Точная: диапазон перемещения - 0.2 мм на оборот рукоятки; грубая: 37.7 мм/оборот; минимальный шаг: 2 мкм, поворотом рукоятки точной фокусировки, расположенной с левой стороны; регулировка поворотного усилия рукоятки грубой настройки; столик снабжен системой рефокусировки
Предметный столик:	160 мм о столик с градуировочной шкалой.; с делением 1° и шкала нониуса с шагом 0,1°
Осветители	Галогеновые лампы 6 В, 20 Вт с предварительной центровкой и фокусировкой; плавная регулировка интенсивности света
Объективы	CFI P Achromat 4X, 10X, 20X, 40X, 100X (МИ) для эпископического освещения: CFI LU Plan Epi P 5X,10X, 20X, 50X, 100X
Эпископический осветитель:	Эпископический осветитель L-IM
Конденсор	Специальный, без натяжения, поворотно-откидной
Поляризатор ДИК	Крепится к основанию блока конденсора
Компенсатор	Стандартная ¼ λ пластина, кварцевый клин или компенсатор Сенармона устанавливаются в слот промежуточного тубуса

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и комплектацию без предварительного уведомления.
Декабрь 2001. ©2000/01 NIKON CORPORATION

ВНИМАНИЕ!	ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

ISO 9001 — NIKON CORPORATION Instruments Company

ISO 14001 — NIKON CORPORATION Yokohama Plant

Stormoff® group of companies

Официальный представитель Nikon в России
125040, Россия, Москва, ул. Расковой, 11А
Тел./факс: (495) 780-0795, 956-0557
E-mail: lab@stormoff.com
Internet: www.stormoff.com

Университет микроскопии — www.microscopyu.com
Микроскопы Nikon — www.nikoninstruments.eu
www.nikon-microscope.ru

Nikon NIKON CORPORATION